

MODALITES DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES

Type de diplôme : MASTER
 Mention Licence
 Mention Licence pro
 Mention Master
 Mention Spécifique
 Parcours type : Systèmes distribués et technologies de la data science (SDTS)

Master : Optique, image, vision, multimédia. Parcours Systèmes distribués et technologies de la data science (SDTS)

Semestre	Nature : UE ou ECUE	Libellé de l'UE ou ECUE	Régime régulier/général											Régime dérogatoire			Régime régulier et dérogatoire			note seuil	
			Contrôle continu et/ou contrôle terminal						Contrôle continu intégral - CCI						Examen			2ème session / 2de chance			
			Epreuves continues			Epreuve terminale/Examen			Epreuves continues						Epreuve terminale/Examen						
			Ecrit %	Oral %	TP%	Nombre d'épreuves	Ecrit %2	Oral %3	TP%4	Ecrit %5	Oral %6	TP%7	Nombre d'épreuves8	Ecrit %9	Oral %10	TP %	Ecrit %11	Oral %12	TP%13		
S1	UE	Conception et analyse d'algorithmes						50		50	3	50		50							
S1	UE	Programmation orientée objet						50		50	3	50		50							
S1	UE	Analyse et Traitement des données numériques 1						50		50	3	50		50							
S1	UE	Apprentissage non supervisé						60		40	3	60		40							
S1	UE	Techniques d'optimisation						50		50	3	50		50							
S1	UE	Temps réel, systèmes embarqués						50		50	3	50		50							
S1	UE	Anglais S1 OIVM						50	50		3	50	50								
S2	UE	Bases de données						50		50	3	50		50							
S2	UE	Graphes et Algorithmiques						50		50	3	50		50							
S2	UE	Développement Web Front						50		50	3	50		50							
S2	UE	Apprentissage supervisé						50		50	3	50		50							
S2	UE	Analyse et traitement des données numériques 2						50		50	3	50		50							
S2	UE	Gestion de projets							100		3	50		50							
S2	UE	Programmation parallèle et distribuée						50		50	3	50		50							
S2	UE	Programmation pour le multimédia						50		50	3	50		50							
S2	UE	Anglais S2 OIVM						50	50		3	50	50								
S3	UE	Psychologie du travail et gestion du stress						100						100			100				
S3	UE	Gestion des projets						100						100			100				
S3	UE	Certification TOEIC						100						100			100				
S3	UE	Séminaires							100		3			100							
S3	UE-M	Option Métiers SDTS																			
S3	ECUE	Optimisation stochastique						60		40	3	60		40							
S3	ECUE	Bases de données avancées OIVM						40		60	3	40		60							
S3	ECUE	Cloud computing						40		60	3	40		60							
S3	ECUE	Apprentissage profond						60		40	3	60		40							
S3	ECUE	Processus métiers						50		50	3	50		50							
S3	UE-M	Option Artisan de l'image (FA)																			
S3	ECUE	Création d'environnement						40		60	3	50		50							
S3	ECUE	Création et animation de personnage						40		60	3	50		50							
S3	ECUE	Effets et compositing						40		60	3	50		50							
S3	ECUE	Narration						40		60	3	50		50							
S4	UE	Stage S4 OIVM-SDTS									100					100					

1. MODALITES DU CONTRÔLE DE L'ASSIDUITE (nombre d'absences autorisées...) :

Participation obligatoire aux cours, TP, TD, projets en présentiel comme en distanciel.